

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (IV EDICIÓN)

Datos básicos del Curso	Curso Académico	2011 - 2012
	Nombre del Curso	Microscopía Electrónica de Barrido (IV Edición)
	Tipo de Curso	Curso de Formación Continua
	Número de créditos	25,00 horas
Dirección	Unidad organizadora	Centro de Investigación Tecnológica e Innovación (C.I.T.I.U.S.)
	Director de los estudios	D Manuel Jiménez Melendo
Requisitos	Requisitos específicos de admisión a los estudios	
	Criterios de selección de alumnos	
Preinscripción	Fecha de inicio	13/02/2012
	Fecha de fin	26/02/2012
Datos de Matriculación	Fecha de inicio	01/03/2012
	Fecha de fin	20/03/2012
	Precio (euros)	220,00 (tasas incluidas)
	Pago fraccionado	No
Impartición	Fecha de inicio	10/04/2012
	Fecha de fin	22/05/2012
	Modalidad	Presencial
	Idioma impartición	Español
	Lugar de impartición	Servicio de Microscopía - CITIUS (Avda. Reina Mercedes 4b, 41012 Sevilla)
	Prácticas en empresa/institución	No
Información	Teléfono	954557483
	Web	
	Facebook	
	Twitter	



Email

cvaquero@us.es



MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (IV EDICIÓN)

Objetivos del Curso

El objetivo del curso es formar adecuadamente a los alumnos, tanto a nivel teórico como práctico, de manera que al finalizar el mismo sean capaces de manejar de forma autónoma un microscopio electrónico de barrido y elegir adecuadamente el modo de trabajo según el tipo de muestra.

Procedimientos de Evaluación

Asistencia, Pruebas

Comisión Académica

D^a. Cristina Vaquero Aguilar. Institución no universitaria - Servicio de Microscopía - CITIUS
D. Manuel Jiménez Melendo. Universidad de Sevilla - Física de la Materia Condensada

Profesorado

D. Manuel Jiménez Melendo. Universidad de Sevilla - Física de la Materia Condensada
D^a. Cristina Vaquero Aguilar. - Servicio de Microscopía - CITIUS

Módulos del Curso

Módulo 1. Microscopía Electrónica de Barrido

Número de horas: 62,50 horas

Modalidad de impartición: Presencial

Contenido:

1. Fundamentos de la microscopía electrónica de barrido.
2. Preparación de muestras.
3. Visualización y obtención de imágenes en:
 - Alto vacío. Detectores de electrones secundarios y electrones retrodispersados.
 - Bajo vacío. Detector de electrones retrodispersados.
4. Obtención de imágenes por microscopía electrónica de barrido de alta resolución.
5. Análisis elemental mediante rayos X.
6. Configuración de parámetros según el tipo de muestras.

Fechas de inicio-fin: 10/04/2012 - 22/05/2012

Horario: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
En horario de mañana y tarde